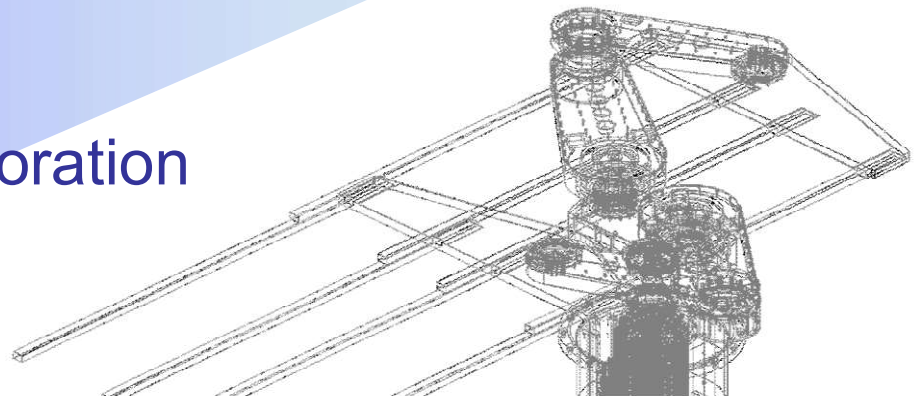


アイテックのご紹介

Aitec Corporation



株式会社アイテックについて

(株)アイテックは2000年4月愛知県一宮市に設立された半導体・FPD基板搬送ロボットメーカーです。アイテックは自社で開発、設計、販売、アフターサービスを行い、製造は日本国内の協力会社、または韓国DST Robot社に委託しています。

設立： 2000年4月
資本金： 100,000,000円
代表取締役： 中野清憲
事業内容： 半導体、液晶製造装置等用基板搬送ロボット及びシステムの開発、販売、アフターサービス

本社： 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字吉田前41
電話： 0586-64-8071 FAX： 0586-64-8078

USA事務所： Berkeley, California 94704 USA
電話： +1-408-393-1772 FAX： +1-925-462-2770

韓国提携先： DST Robot Co., Ltd.
<http://www.dongburobot.com/jsp/cms/view.jsp?code=100670>

台湾提携先： Burgeon Instrument Co., Ltd.
<http://www.burgeon.com.tw/>

アイテックの基板搬送ロボット

アイテックでは半導体ウエハ用とFPD向けガラス基板用の真空ロボットと大気ロボットを取り揃えています。

アイテックの高精度で信頼性の高い搬送ロボットは世界中の半導体、FPD製造ラインで使われています。

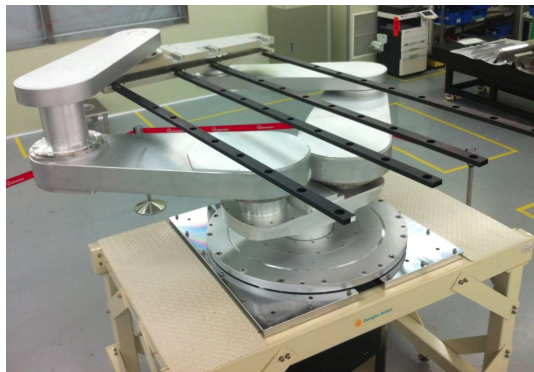
アイテックではこれまでに1,000台を超える搬送ロボットを出荷しています。

半導体ウエハ用ロボット： 約 500台

FPDガラス基板用ロボット： 約 650台

(2017年12月末現在)

FPDガラス基板用真空ロボット



FPDガラス基板用大気ロボット



半導体用真空ロボット



半導体用大気ロボット



Vacuum Robot For Semiconductor Wafer



AR-WV350

Model		AR-SV350	AR-WV350	AR-WV300
Wafer Size		≤ 450mm	≤ 450mm	≤ 300mm
Stroke (mm)	A	705	760	545
	B	-	760	545
	Θ	∞	∞	330
	Z	80	80	50
Motion Speed	A/B	0.7sec/FS	1.1sec/FS	1.1sec/FS
	Θ	1.4sec/FS	2.2sec/FS	2.2sec/FS
	Z	0.6sec/FS	1.1sec/FS	1.1sec/FS
Position Repeatability	A/B	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
	Θ	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
	Z	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
Vacuum Range		1 x 10 ⁻⁶ Pa	1 x 10 ⁻⁶ Pa	1 x 10 ⁻⁶ Pa
Operating Environment	Atmospheric side	Temp.: 0~40°C Humidity: < 70%	Temp.: 0~40°C Humidity: < 70%	Temp.: 0~40°C Humidity: < 70%
	Vacuum side	Temp.: 0~80°C	Temp.: 0~80°C	Temp.: 0~80°C

Atmospheric Robot For Semiconductor Wafer



AR-S300H



AR-S300R



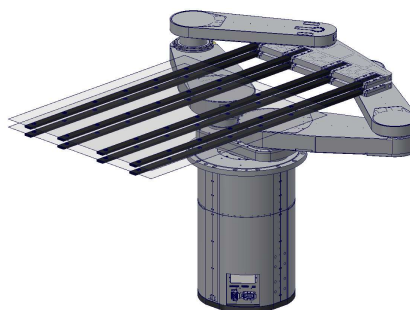
AR-W300H

Model		AR-S300H	AR-SH300	AR-W300H	AR-WH300
Wafer Size		≤ 300mm	≤ 300mm	≤ 300mm	≤ 300mm
Stroke (mm)	A	510	510	510	510
	B	-	-	510	510
	Θ	330	330	330	330
	Z	300	350	300	350
Motion Speed	A/B	0.8sec/FS	3.7sec/FS	0.8sec/FS	3.7sec/FS
	Θ	1.2sec/FS	3.4sec/FS	1.2sec/FS	3.4sec/FS
	Z	1.0sec/FS	2.1sec/FS	1.2sec/FS	2.1sec/FS
Position Repeatability	A/B	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
	Θ	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
	Z	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
Operating Environment		Temp.: 0~40°C Humidity: < 70%	Temp.: 0~40°C Humidity: < 70%	Temp.: 0~40°C Humidity: < 70%	Temp.: 0~40°C Humidity: < 70%

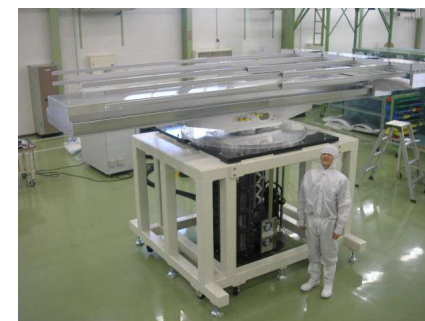
Vacuum Robot For FPD Glass Substrate



AR-SV3G



AR-WV6G



AR-WV8.6G

Model		AR-SV3G	AR-WV5S	AR-WV5.5S	AR-WV6G	AR-WV8.6G
Glass Substrate Size		Gen. 3	Gen. 4.5 / 5	Gen. 5.5	Gen. 6	Gen. 8.5~8.6
Stroke (mm)	A	1,030	1,700	2,380	2,800	3,900
	B	-	1,700	2,380	2,800	3,900
	Θ	330	∞	∞	∞	330°
	Z	100	350	350	580	680
Motion Speed	A/B	4.5sec/FS	3.0sec/FS	2.5sec/FS	2.5sec/FS	2.7sec/FS
	Θ	3.0sec/FS	3.0sec/FS	3.5sec/180deg	3.5sec/180deg	3.5 sec/180deg
	Z	1.5sec/FS	2.0sec/FS	2.0sec/FS	2.5sec/FS	3.0 sec/FS
Position Repeatability	A/B	±0.1mm	±0.1mm	±0.3mm	±0.5mm	≤±0.5mm
	Θ	±0.1mm	±0.1mm	±0.3mm	±0.5mm	≤±0.5mm
	Z	±0.1mm	±0.1mm	±0.3mm	±0.5mm	≤±0.5mm
Vacuum Range		1 x 10 ⁻⁴ Pa	1 x 10 ⁻⁴ Pa	1 x 10 ⁻⁴ Pa	1 x 10 ⁻⁴ Pa	1 x 10 ⁻⁵ Pa
Operating Environment	Atmospheric side	Temp.: 0~40°C Humidity: < 70%	Temp.: 0~40°C Humidity: < 70%	Temp.: 0~40°C Humidity: < 70%	Temp.: 0~40°C Humidity: < 70%	Temp.: 0~40°C Humidity: < 70%
	Vacuum side	Temp.: 0~80°C	Temp.: 0~80°C	Temp.: 0~80°C	Temp.: 0~80°C	Temp.: 0~80°C

Atmospheric Robot For FPD Glass Substrate



AR-3GSR



AR-3GW



AR-4GSR



AR-4GW

Model		AR-3GS	AR-3GW	AR-4GS	AR-4GW
Substrate Size		Gen. 3	Gen. 3	Gen. 4	Gen. 4
Stroke (mm)	A	1,120	1,120	1,460	1,460
	B	-	1,120	-	1,460
	Θ	330	330	330	330
	Z	400	400	800	800
Motion Speed	A/B	1.8sec/FS	1.8sec/FS	1.8sec/FS	1.8sec/FS
	Θ	3.5sec/FS	3.5sec/FS	3.5sec/FS	3.5sec/FS
	Z	3.7sec/FS	3.7sec/FS	3.0sec/FS	3.0sec/FS
Position Repeatability	A/B	± 0.1 mm	± 0.1 mm	± 0.1 mm	± 0.1 mm
	Θ	± 0.1 mm	± 0.1 mm	± 0.1 mm	± 0.1 mm
	Z	± 0.1 mm	± 0.1 mm	± 0.1 mm	± 0.1 mm
Operating Environment		Temp.: 0~40°C Humidity: < 70%	Temp.: 0~40°C Humidity: < 70%	Temp.: 0~40°C Humidity: < 70%	Temp.: 0~40°C Humidity: < 70%